(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/205174 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/677 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/010223

(22) 国際出願日： 2025年3月17日(17.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-056475 2024年3月29日(29.03.2024) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 (JP).

(72) 発明者: 大城 凱(**OSHIRO, Kai**); 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢６５０ 東京エレクトロン株式会社内 (JP). 豊巻 俊明(**TOYOMAKI, Toshiaki**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).

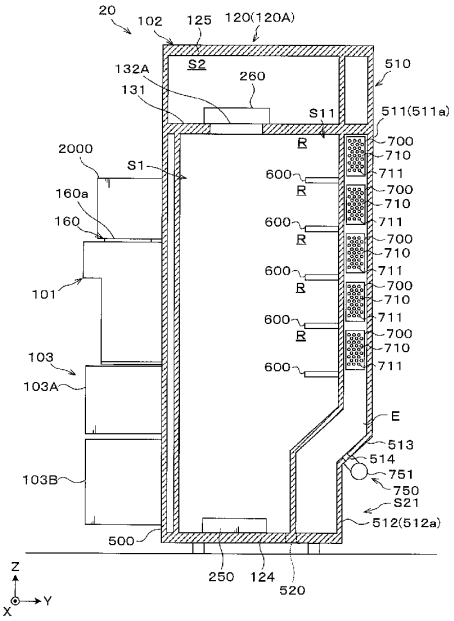
(74) 代理人: 金本 哲男，外(**KANEMOTO, Tetsuo** et al.); 〒1620065 東京都新宿区住吉町１－２０ 角張ビル 曙国際特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,

(54) **Title:** CONVEYANCE DEVICE AND DISCHARGE METHOD

(54) 発明の名称： 搬送装置及び排気方法



(57) **Abstract:** Provided is a conveyance device for carrying a substrate into and out from a processing device for processing a substrate, the conveyance device comprising a main body having a conveyance space in which a conveyance robot for conveying the substrate is provided and a storage space that is connected to the conveyance space and supports the substrate, the main body being provided with: a housing that constitutes the conveyance space, the housing having a wall portion that forms a front surface to which a load port having a substrate-accommodating container mounted thereon is connected, a rear surface to which a load lock provided to the processing device is connected, and a pair of side surfaces connecting the front surface and the rear surface in the device depth direction, and also having a columnar member connected to the wall portion; and a discharge path for discharging a gas that is supplied to the storage space, the discharge path being formed within the columnar member of the housing.

WO 2025/205174 A1

［続葉有］

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：基板を処理する処理装置に対して基板を搬入出する搬送装置であって、前記基板を搬送する搬送ロボットが設けられる搬送空間と、前記搬送空間に連結され、前記基板を支持するストレージ空間と、を有する本体部を有し、前記本体部は、前記搬送空間を構成する筐体であって、前記基板を収容する容器が載置されるロードポートが連結される前面と、前記処理装置に設けられたロードロックが連結される後面と、前記前面と前記後面とを装置奥行方向で連結する一対の側面と、を形成する壁部と、前記壁部と連結される柱部材と、を有する前記筐体と、前記ストレージ空間に供給された気体を排気する排気路と、を備え、前記排気路は、前記筐体の前記柱部材内に形成される。